

エンボステープ中の半導体チップを高速で帯磁検査

MRI(核磁気共鳴映像)システム製造のため適切な材料と部品を選定する際は、MAGNETOSCOPE や MAGNETOMAT で 比透磁率 μ_r を測定し残留磁気を検出します。これは電子顕微鏡の製造にも応用できる使用方法です。

フェルスターの MAGNETOMAT と高感度プローブを使えば、エンボステープに入ったまま半導体チップの帯磁検査を高速で行い、検査記録も残す事が出来ます。周囲の磁気ノイズの影響を最小限に抑え、微弱な磁気をも測定するために、非磁性体で作られた専用の測定用台も用意しております。



周辺磁気ノイズ対策済測定台



MAGNETOMAT 1.782

まだ以下の特徴を持つ MAGNETOMAT 1.782 は最適条件下では1秒間に 500 個の検査を行う事も可能です。

- PC 制御のフラックスゲート磁力計
- 磁束密度(絶対値または勾配値)の測定
- 比透磁率 μ_r 測定用プローブ(IEC 60404-15 および ASTM A342M 準拠)
- 多重チャンネルのプローブ配列
- トリガーインターフェース
- データ収集および解析ソフトウェア
- データ収集管理機能およびデータ伝送インターフェース

磁力の単位の一つである磁束密度 B は、装置エリアで磁束方向に対して垂直に捉えた磁束の量を表し、ベクトル場として表すこともできます。フラックスゲートセンサーは B の大きさと方向を測定できます。適切なセンサーを付けた MAGNETOSCOPE や MAGNETOMAT を使用して、同時に 1 ~3 方向の磁束密度を測定可能です。差動型プローブを使用すれば、1 方向の磁束密度勾配値を測定することができます。

→ [本製品・アプリケーションに関するお問い合わせ・資料請求はこちらから](#)